# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-037625

(43) Date of publication of application: 19.02.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/1333 G02F 1/1343

(21)Application number: 01-173782

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

04.07.1989

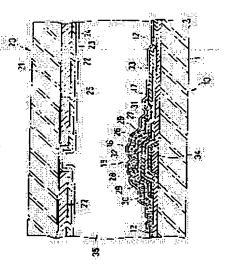
(72)Inventor: MIZUSHIMA SHIGEMITSU

## (54) ACTIVE MATRIX DISPLAY DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent image quality from deteriorating even if the orientation of liquid crystal is disordered by forming a light shield film overlapping with at least part of the outer peripheral part of a picture element electrode.

CONSTITUTION: The source electrode 30 and drain electrode 31 of a TFT 15 are formed at the same time with a source bus line 13 and the picture element electrode 12 is connected to the drain electrode 31. Further, the light shield film 33 which shields an area where liquid crystal orientation is disordered from light is formed in contact with the drain electrode 31. Part of the picture element 12 formed on a gate insulating film 27 is superposed on the light shield film 33 and a protection film 16 is patterned and formed in an area other than the area where the picture element electrode 12 is formed. Consequently, even if the liquid crystal orientation is disordered, the image quality does not deteriorate, so the yield of the display device is improved and the cost is reducible.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-37625

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)2月19日

G 02 F

1/1333 1/1343 500

7610-2H 7610-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称

アクテイブマトリクス表示装置

②特 願 平1-173782

②出 類 平1(1989)7月4日

@発明者 水嶋

签 光

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 顋 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

**郊代 理 人** 弁理士 山本 秀策

明 細 杏

#### 1. 発明の名称

アクティブマトリクス表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも一方が透光性を有する一対の基板と、 該一対の基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配された絵素電極と、 該一対の基板間に対入され、印加電圧に応答して光学的特性が変調される表示媒体と、 を有するアクティブマトリクス表示装置であって、

按檢索電極の外周部の少なくとも一部に重要して、 遮光線が形成されているアクティブマトリクス 変示 装置。

2. 前記絵衆電極が形成された基板内面に、機能条子を領え、前記遮光腹が、接機能素子内に形成された不透明層と同じ材料で形成されている、 請求項1に記載のアクティブマトリクス表示装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、表示媒体として液晶等を用いた、ア

クティブマトリクス表示装置に関する。

(従来の技術)

近年、CRTに代わる表示装置として、液晶等を用いた表示装置の研究が行われている。 これらの表示装置に於いては、「TO、SnOュ等を用いた絵彙電極と対向電極との間に、液晶等の表示媒体が封入され、これらの電極の間に電圧が印加されて表示が行われる。

1 TO、SnO₂等の透明電極により形成される 絵葉電極の外周には、誘起ドメインと呼ばれる液 弱の配向の乱れた領域が現れることがある。この 乱れは、絵葉の外周部に生じる電気力線の乱れに 起因している。第7回回に示す表示では、かわいる。第7回に示す表示では、からなる。 の図に介では、第7回に示す表示では、から ゆる単純マトリクス型の液晶気力線36は、砂切の の図に於て破線で示する。この を板11上の絵葉電極12から、対向を板21上 の対向電極23に向かって、能らみを生じている の対向電極23に向かって、能らの形状に大きく の対応のようの程度は、絵葉電の災角の角の に、絵葉電の災角の角の 61.

再限トランジスタ(以下では「TFT」と称する)等のスイッチング条子を育するアクティック カリクス型の表示装置では、上記の電気力線36の影らみに加え、 絵葉電極12の周囲に定続されるインと、 絵葉電極との間に生じる電位登によるで、 なるの乱れは生ずる。 このような 延りの 説 乱れによって、 パスラインと 絵葉電極の外の 液晶の配向の乱れが生じ、 更には 絵葉電極の外 周部より内側の液晶の配向まで乱れることがある。

この区向の乱れは、無電界時に於ける液晶分子と電極表面との角度(ブレチルト角)に関係し、また、電界印加時の液晶分子と電極表面との角度(チルト角)にも関係する。 従って、液晶の配向の乱れが生じる場所、及び程度は、ラビング、斜め蒸着等の配向処理により異なる。

液品配向の乱れが生じると、表示されている絵 衆の一部が、他の部分とは異なった表示状態となる。例えば、正方形の絵素電価を有するTN-F

下のような問題点を有している。

まず①では、自由なパターン表示が制限される という欠点が生じる。また、高精細な表示を行う マトリクス表示装置に於いては、①の対策では妨 ぎようがない。

②によれば、選圧 - 透過率特性曲級の急峻性が 損なわれる。そのため、コントラスト及び応答選 度が低下し、現角範囲が狭小となる。また、高ブ レチルト角を得るためには、材料及びプロセスに 対する制約が大きく、他の特性の犠牲を招く場合 がある。

③によれば、以下のような欠点が問題となる。まず、ブラックマスクを絵素電極形成基板側に設ける場合を考える。ブラックマスクを金瓜で形成すると、ブラックマスクとパスラインとの間に、大きな電気容量が生じる。そのため、表示状態に、問題が生じ、絵素電極を駆動する上でも問題となる。ブラックマスクを出脂で形成すると、遮光性を確保するために限厚を大きくする必要があり、パターン特度、セルのギャップの均一性等に問題

EM・LCDでは、絵葉の辺の近傍領域の最適視角方同が、他の領域のそれとは逆になり、絵葉の一部が欠損したように見える場合がある。 このような場合の配向の乱れを、リバースチルトと呼ぶことがある。

上述の問題点を解決するため、従来より下記の 対策がとられてきた。

① 絵素電極の鋭角の部分を無くし、鈍角とする。 ② プレチルト角を大きくする。

② 給業部分以外の部分を通過する光を遮断する
ためのブラックマスクを、 給業の内部にも重ねて、
異常部分を関す。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、このような従来の対策は、それぞれ以

が生じる。 従って、 ブラックマスクを絵素電極が 形成される基板側に設けることは好ましくない。

次に、ブラックマスクを対向基板側に設けた場合を考える。この場合には、2枚の基板の位置ずれの誤差を考慮したパターン設計が必要となる。 2枚の基板の合わせる場合の位置特度は、5~1 0μmと低い。そのため、必要なブラックマスク と検索電極との置なりを5μmとすると、10μ m以上の異な合わせの設計が必要となる。このように大きな異ね合わせを行うと、 検索の開口率が 低下し、表示側面が暗くなるという問題が生じる。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、本発明の目的は、液晶配向の乱れを生じても、 國際品位が低下しないアクティブマトリクス表示 装置を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明のアクティブマトリクス表示整理は、少なくとも一方が選先性を有する一対の基板と、該一対の基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配された絵素電極と、該一対の基板関に封入



され、印加電圧に応答して光学的特性が変調される表示媒体と、を有するアクティブマトリクス要示装置であって、成絵楽電極の外周部の少なくとも一部に重要して、遮光膜が形成されており、そのことによって上記目的が速成される。

また、前記絵業電極が形成された基板内面に、 機能架子を備え、前記遮光膜が、 抜機能需子内に 形成された不透明層と同じ材料で形成された構成 とすることもできる。 機能案子としては、 TFT、 MIM(金属 — 絶縁層 — 金属)、 MOSトランジ スタ、 ダイオード、 バリスタ等が挙げられる。 (作用)

本発明のアクティブマトリクス表示装置では、 被品配向の乱れが発生する給素電極の外周部の、 少なくとも一部に重要して、 透光膜が形成されて いる。 この週光数により、 表示の乱れが生じた領 域を隠すことができる。

また、本発明の表示装置では、絵衆電極が形成された基板内面に機能楽子を備え、遮光膜をこの機能素子内に形成された不透明層と同じ材料で形

成した構成としてもよい。 このような構成により、 表示装置の製造工程を増加させることなく、 上記 の遮光額を形成することができる。

#### (実施例)

本発明を実施例について以下に説明する。 第1 図に本発明の表示装置を構成するアクティブマトリクス 25版の一実施例の平面図を示す。 第1 図の田 - 田 44 に沿った断面図を第3 図に示す。 過明基板上にTaから成るゲートバスライン1 4 に直交して、TIから成るソースバスライン1 3 が設けられている。 ゲートバスライン1 4 と、ソースバスライン1 3 との交点近傍のゲートバスライン1 4 上には、スィッチング素子としてTFT15 が形成されている。

TFT15のソース電極30及びドレイン電極31は、ソースパスライン13と同時に形成される。ドレイン電極31には検索電極12が接続されている。更に、ドレイン電極31に接して、底品配向の乱れが発生した領域の避光を行うための、

進光膜33が形成されている。

TFTI5及び近光限33の前面構成を、第3 図に世である。ゲートで34上に、陽極なって説明する。ゲートで34上に、陽極なったが一トの間ではなれた、 この間ではないがある。 かった 25 では、 アクーン 27 では、 アクーン 27 では、 アクーン 27 では、 アクーン 29 では、 アクトのに 29 では、 アクトのに 29 では、 アクトのに 20 では、 アクトで 29 では、 アクトの 29 では、 25 では、 25 では 25 では 27 では 28 では 27 では 28 では 29 では 28 では 29 では

コンタクト暦29上には、上述のソース電極3 0及びドレイン電極31が形成されている。ドレイン電極31の形成時に、前述の遮光膜33が同時にパターン形成される。本実施例では遮光膜3 3は、ドレイン電極31に電気的に接続された状 態で形成される。 遮光膜 3 3 上には、ゲート絶縁 膜 2 7 上に形成された絵素 軽極 1 2 の一部が重璧 されている。

配向膜 [7及び24にはポリイミド系樹脂(日本合成ゴム社製、オプトマーAL)、液晶 35には PC H系ブレンド液晶 (チッ素 (株) 製) を用いた。

第2図に、本実施例の表示技能に於て、 液晶配 向の乱れが生じている領域を示す。 この場合の是

## 符開平3-37625(4)

連視角方向は、抵面から抵面の手前上方に向かう方向である。 東2図に示すように、 絵案電篷12のTFT15が接続される辺に沿った、 斜線で示す領域 A に、 被晶配向の乱れが生じていることが破むされている。 この配向の乱れが発生する領域 t 、 連光膜 3 3 を有していない表示装置を作製することにより、 確認性 1 2 の端部から2~10 μの 領域に形成される。 本実施例のように選光膜 3 3 を設けることにより、 表示不良の問題のない良好な表示装置が得られることが確認された。

第4図~第6図に、本発明の表示装置に用いられる過光膜33の他の形状を示す。 第4図~第5図に於ける最適視角方向は、第2図と同様に抵面から抵面の手前上方に向かう方向である。 これらの遮光膜33の形状は、液晶配向の乱れが発生している領域の形状に合わせて決定される。

本実施例では遮光膜33をソース電極30及びドレイン電極31と同じ材料で形成したが、ゲート電極と同じ材料で形成してもよい。その場合に

は、 遮光膜 3 3 はゲート電揺 3 4 及びゲートバス ライン 1 4 と同時に形成され、ゲート電揺 3 4 及 びゲートパスライン 1 4 からは電気的に孤立して 設けられるのが好ましい。

本実施例ではスイッチング素子として、 TFTを用いた場合について説明したが、 本発明は、他のスイッチング素子、 例えば MOSトランジスタを用いた表示装置にも適用することができる。

また、本実施例では機能素子としてスイッチング素子を用いた場合について説明したが、スイッチング素子以外の他の機能素子、例えばMIM、ダイオード等を備えた表示装置にも適用することができる。この場合には、スイッチング素子以外の機能素子を構成する不透明歴と同じ材料を用いて、遅兆膜を形成することができる。

#### (発明の効果)

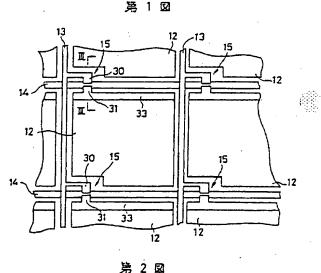
本発明のアクティブマトリクス表示装置では、 液晶配向の乱れが生じても、画像品位が低下しない。従って、本発明によれば表示装置の歩留りが 同上し、表示装置のコスト低減が為される。

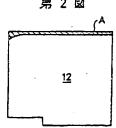
#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の一実施例の平面図、第2 図は液晶配向の乱れが生じている領域を示す図、第3 図は第1 図のⅢ-Ⅲ線に沿った断面図、第4 図~第6 図は遮光線の他の実施例を示す平面図、第7 図は単純マトリクス型表示装置に生じる電気力線の様子を示す断面図である。

10…アクティブマトリクス基板、11,21 …透明基板、12…絵素電極、13…ソーズバス ライン、14…ゲートバスライン、15…TFT、 15…保護膜、17,24…配向膜、20…対向 基板、22…カラーフィルタ、23…対向電極、 25…ブラックマスク、26…陽極酸化膜、27 …ゲート絶縁膜、28…半導体層、29…コンタ クト層、30…ソース電極、31ドレイン電極、 32…絶縁膜、33…遮光膜、34…ゲート電極、

口上





第 5 図